

Круглый Корзинчатый Держатель Для 6-Дюймовых Пластин Из Птфэ, Устойчивый К Кислотам И Щелочам, Для Очистки Полупроводников, С Возможностью Кастомизации

Артикул: PL-CP55



введение

Высокочистые держатели для 6-дюймовых пластин из ПТФЭ, предназначенные для ответственных этапов жидкостной обработки полупроводников. Благодаря разработанной конструкции обеспечивает превосходную химическую стойкость и термическую стабильность. Эти настраиваемые корзинчатые держатели гарантируют равномерную очистку и защиту подложек в агрессивных кислых и щелочных средах при погружении на всех этапах производства.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Очистка RCA полупроводников	Погружение пластин в растворы SC-1 и SC-2 для удаления органических и ионных загрязнений.	Полная устойчивость к окислителям и высокотемпературным основаниям.
Процессы мокрого травления	Селективное удаление слоев материала с использованием плавиковой (HF) или фосфорной кислоты.	Точное позиционирование подложки обеспечивает равномерную глубину травления по всей пластине.
Удаление фоторезиста после фотолитографии	Удаление слоев фоторезиста с использованием агрессивных органических растворителей или раствора пирани.	Материал не набухает и не разрушается при контакте с агрессивными растворителями.
Текстурирование солнечных ячеек	Массовая очистка и текстурирование поверхности кремниевых пластин для повышения эффективности.	Прочная конструкция выдерживает высокие нагрузки при промышленных объемах обработки химическими реагентами.
Ополаскивание после ХМП	Удаление частиц шлама и химических реагентов после химико-механической полировки.	Ультراгладкая поверхность предотвращает повторное прикрепление частиц и упрощает ополаскивание.
Подготовка к ультраследевому анализу	Очистка высокочистых лабораторных компонентов в концентрированной азотной или соляной кислоте.	Исключает риск перекрестного загрязнения при ультраследевом элементном анализе.
Производство МЭМС	Специализированная транспортировка подложек при производстве микроэлектромеханических систем.	Настраиваемые размеры пазов позволяют работать с подложками нестандартной толщины.

Параметр	Спецификация для PL-CP55
Идентификация продукта	Круглый держатель для пластин PL-CP55 (корзинчатый)
Состав материала	Высокочистый исходный политетрафторэтилен (ПТФЭ)
Совместимость по размеру пластин	Стандарт 6 дюймов (150 мм) (доступны нестандартные размеры)
Конфигурация	Круглая корзинка с пазами / Перфорированная корзинчатая конструкция
Количество пазов / Емкость	Настраивается (стандартные варианты: 10, 25 или 50 пазов)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Параметр	Спецификация для PL-CP55	
Рабочая температура	-200°C до +260°C (-328°F до +500°F)	
Химическая стойкость	pH 0-14 (универсальная стойкость к кислотам, щелочам и растворителям)	
Ширина пазов / Шаг	Полностью настраивается по требованиям пользователя	
Тип ручки	Встроенная неподвижная ручка или съемная поворотная ручка из ПТФЭ (настраивается)	
Обработка поверхности	Гладкая после ЧПУ-обработки (типичное значение Ra ≤ 0,8 мкм)	
Метод изготовления	100% точная ЧПУ-обработка (индивидуальное изделие)	
Габариты	Разработаны под индивидуальные размеры конкретной установки для жидкостной обработки или ванны	